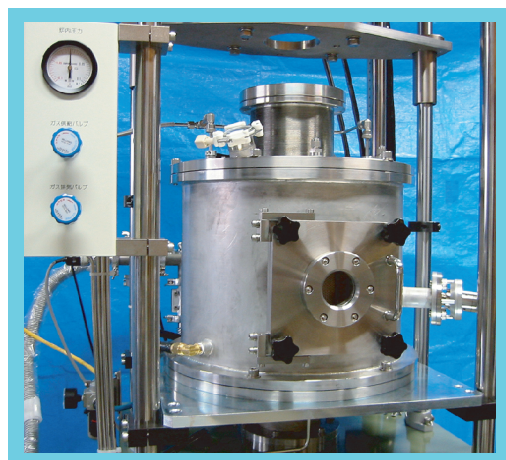


結晶育成装置用缶体

OUCHシリーズ

特長

- 各種結晶育成装置用として真空用及び加圧用を製作いたします。
- 材質はステンレス、冷却は二重水冷ジャケット方式を採用しております。
- 加圧用缶体は関係法令に従って設計・製作をしております。



組み込み使用例

仕様

種類	型式番号	定格
真空用	OUCH-ST	真空～0.1MPa
加圧用1	OUCH-P1	真空～1.0MPa
加圧用2	OUCH-P2	真空～10.0MPa

缶体寸法、覗き窓、各種ポート等のサイズ、数量、位置等はオーダー可能です。

結晶成長装置の専門メーカー



株式会社 テクノサーチ

〒206-0012 東京都多摩市貝取1-60-5 TEL:042-339-1172 FAX:042-357-3911
website : <http://www.techno-search.co.jp/> E-Mail : fvgv1120@mb.infoweb.ne.jp

〒651-1211 兵庫県神戸市北区小倉台6-13-16 TEL/FAX:078-582-3782
E-Mail : fvgv1121@mb.infoweb.ne.jp